

ODP-L シリーズ

大容量型ラップ加工機

上下研磨盤の回転(逆転)によってフェルールの外径を精密に研磨する装置です。
研磨盤の大型化、ワーク投入の簡略化をすることにより、量産性を高めました。

特徴

■ 研磨盤の大型化

研磨盤を大型化する事により、1回で300個(SC)の加工が可能になりました。(LCの場合は500個)

■ ハンドリングの簡略化

下研磨盤の上に4つの穴が開いた樹脂プレートを置き、そこに既定の数量のワークを入れるだけの簡単セッティングです。
小型タイプのワークを並べるといった作業が無くなり、ワークのセッティングが大幅に簡略化されます。

■ 独自の研磨盤

上下研磨盤は、フェール専用溝加工されており、ダイヤモンドスラリーを保持しやすく、外径精度の安定化を実現しています。

■ 細かな条件設定が可能

加工ワークにより、上下研磨盤のスピード、加工時間、回転方向等の細かい条件設定が可能で、設定条件を登録する事により、条件を呼び出すことが可能です。

■ 研磨盤のメンテナンス

通常メンテナンス(1日1~2回)

- ① ワークが無い状態で、共擦り用スラリーを研磨盤に垂らす
- ② 上下研磨盤を接触させ、条件に従い共擦りを行う
- ③ 作業後、研磨盤の清掃を行う

修正メンテナンス(3週間に1回程度)

- ① 本体より研磨盤を取外し、溝の再加工を行う
※ユーザ自信での再加工を希望の場合、加工手順の指導を行います。
- ② 修正完了後、通常メンテナンスを行う

■ 標準仕様 ODP-L2

	SC	LC
加工性能	0.9 μ m/100sec	1.0 μ m/100sec
加工数量	300 pcs	500 pcs
加工	自動	
供給方法	手動(セット治具にワークを流し入れる)	
操作方法	タッチパネル(KEYENCE)	
制御方式	シーケンサ制御(KEYENCE)	

※シーケンサ、タッチパネルはご要望により変更可能です。

■ 消耗品

ダイヤモンドパウダー
灯油
オリーブオイル

ODP-L2

(大容量型ラップ加工機)

■ 寸法図

